

Japanese Utility Model Laid-Open No. Sho 63-57734

Date of Publication :April 18, 1988

Title of the Device: Semiconductor Manufacturing  
Apparatus

What is claimed is:

A semiconductor manufacturing apparatus mounted in a clean room while the clean room is partitioned into a wafer transferring area and a maintenance area characterized in that a sub-operating unit is removably arranged at the maintenance area in addition to an operating unit installed at the wafer transferring area.

#### Brief Description of the Drawings

Fig.1 is a top plan view for showing a semiconductor manufacturing apparatus of one preferred embodiment of the present utility model.

Fig.2 is a constitution block diagram for showing a connecting constitution of a control unit of Fig.1.

1 ... wafer transferring area, 2 ... maintenance area,  
3 ... partition, 4 ... main operating unit, 6 ... apparatus  
main body, 7 ... sub-operating unit, 8 ... connecting  
connector,

In Fig.2: 42 ... keyboard, 61 ... I/O unit, 62 ... micro-  
computer, 63 ... personal computer, 72 ... keyboard

## ⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭63-57734

⑬ Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)4月18日

H 01 L 21/02  
G 06 F 15/46  
H 01 L 21/68

7168-5F  
7313-5B  
A-7168-5F

審査請求 未請求 (全1頁)

⑮ 考案の名称 半導体製造装置

⑯ 実 願 昭61-151468

⑰ 出 願 昭61(1986)10月3日

⑱ 考 案 者 城 尾 和 博 山口県下松市大字東豊井794番地 日立テクノエンジニア  
リング株式会社笠戸事業所内  
⑱ 考 案 者 井 上 智 巳 山口県下松市大字東豊井794番地 日立テクノエンジニア  
リング株式会社笠戸事業所内  
⑱ 考 案 者 西 畑 廣 治 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠  
戸工場内  
⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地  
⑲ 出 願 人 日立テクノエンジニア リング株式会社 東京都足立区中川4丁目13番17号  
⑳ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

## ⑳ 実用新案登録請求の範囲

クリーンルーム内にウエハ搬送用エリアとメン  
テナンスエリアとに間仕切りして設置される半導  
体製造装置において、前記ウエハ搬送用エリア側  
に設けられた操作部とは別に、前記メンテナンス  
エリア側に副操作部を着脱可能に設けたことを特  
徴とする半導体製造装置。

## 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例である半導体製造装

置を示す平面図、第2図は第1図の制御部の接続  
構成を示す構成ブロック図である。

1……ウエハ搬送用エリア、2……メンテナ  
ンスエリア、3……間仕切り、4……主操作部、6  
……装置本体、7……副操作部、8……接続用コ  
ネクタ。

